

第 8 回 偏光計測研究会

日時 : 2012 年 6 月 29 日 金曜日 10:15~17:30

場所 : 株式会社堀場製作所 東京セールスオフィス

東京都千代田区神田淡路町二丁目 6 番 神田淡路町二丁目ビル

参加費 : 一般 3,000 円、学生 300 円

【プログラム】

- 10:15 - 10:20 開会の辞

- 10:20 - 11:20
チュートリアル 1 : Mueller ellipsometry: Basic Principles, Instrumentation and Applications
E. Garcia-Caurel (LPICM, Ecole Polytechnique, CNRS, France)

- 11:20 - 11:30 休憩

- 11:30 - 12:30
チュートリアル 2 : Graphene and Plasmonics: the Nanoscale Challenges for Real-time Spectroscopic Ellipsometry
Maria Losurdo (Institute of Inorganic Methodologies and of Plasmas, IMIP-CNR, Italy)

- 12:30 - 14:00 昼食休憩
(13:15 - 事前申込の方のみ、堀場製作所東京分析センター見学)

- 14:00 - 14:30
講演 1 : High-speed 透過型 Four Detector Polarimeter の開発
川畑州一¹, 津留俊英², 田所利康³ (東京工芸大¹, 東北大多元研², テクノシナジー³)

- 14:30 - 15:00
講演 2 : 半連続金属膜近傍における半導体ナノ結晶の発光遷移特性
中村俊博, 古田和也, 安達定雄 (群馬大学大学院工学研究科)

- 15:00 - 15:30
講演 3 : Real-time monitoring of optical anisotropy in the growth of PEDOT:PSS composite by electro spray deposition (ESD) using spectroscopic ellipsometry for crystalline Si heterojunction solar cells
日當大我, 渡辺恭平, 石川良, 上野啓司, 白井肇 (埼玉大理工)

- 15:30 - 15:50 休憩

- 15:50 - 16:20
講演 4 : 斜入射検出器を用いた真空紫外エリプソメータによるストークス・パラメータおよび光学定数測定
齋藤輝文¹, 尾崎恭介², 福井一俊², 岩井浩紀², 山本晃司³, 三宅秀人⁴, 平松和政⁴ (東北工大工¹, 福井大工², 福井大遠赤³, 三重大工⁴)
- 16:20 - 16:50
講演 5 : イオン液体のソフト界面の分光エリプソメトリー
西直哉, 粕谷浩二, 大神諒, 垣内隆 (京大院工)
- 16:50 - 17:20
講演 6 : 高分子/液晶ホログラフィック格子が有する光学異方性の θ - 2θ 分光回折法による解析
垣内田洋*, 吉村和記, 田澤真人, 荻原昭文† (産総研、神戸高専†)
- 17:20 - 17:30 閉会の辞
- 18:00 - 懇親会
場所 : トラットリア カンティーニ 神田淡路町店
<http://kantini2008.net/index.html>
千代田区神田美土代町 11-1 神田 KM ビル B1
03-3295-5051
参加費 : 一般 4,500 円, 学生 3,000 円

お問い合わせ先 :

第 8 回偏光計測研究会 事務局 : ナタリア ナバトバ-ガバイン
(株式会社堀場製作所 東京セールスオフィス内)

E-mail: sales.hor@jp.horiba.com